

显微分光膜厚仪

OPTICAL THICKNESS METER

OP series

All Matters, All Solution.

非接触 · 非破坏 · 显微方式
测量时间 1秒!

In a non-contact non-destructive microscopic
from now Measurement time of 1 second!



嵌入型测试头



自动 XY平台

R&D ! QC ! 植入设备 ! 都可简单实现高精度测量 !

For R&D, For QC, For Built in type, we provide the useful system!

测量目标膜的绝对反射率，实现高精度膜厚和光学常数测试！

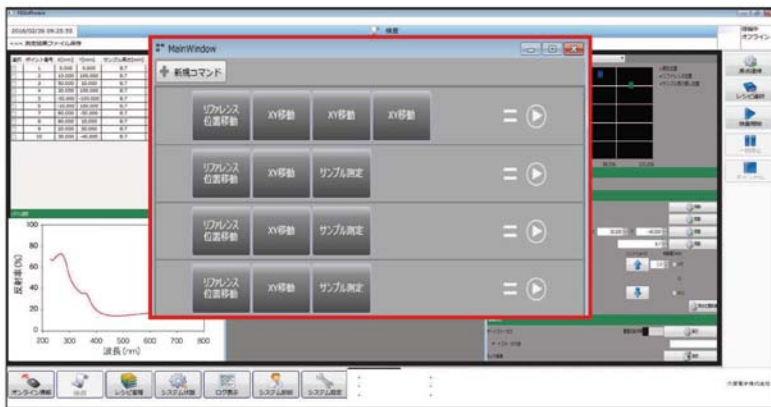
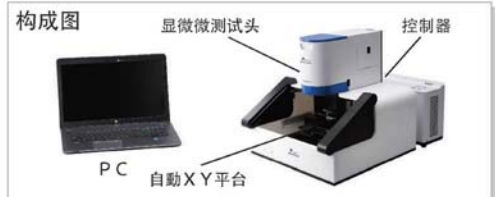
(分光干涉法)

特长 Features

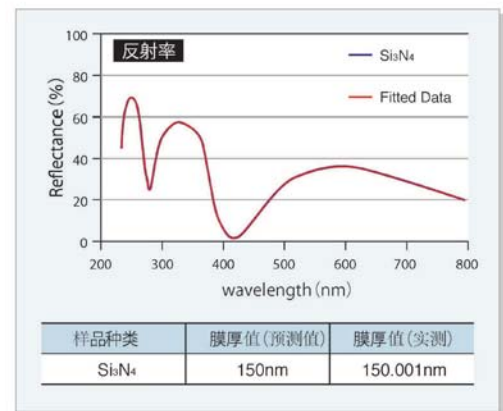
- 膜厚测量中必要的功能集中于头部
- 通过显微分光高精度测量绝对反射率（多层膜厚、光学常数）
- 1点只需不到1秒的高速tact
- 实现了显微下广测量波长范围的光学系（紫外~近红外）
- 通过区域传感器控制的安全构造
- 搭载可私人定制测量顺序的强大功能
- 即便是没有经验的人也可轻松解析光学常数
- 各种私人定制对应（固定平台，有嵌入式测试头式样）

测量项目 Measurement item

- 绝对反射率测量
- 膜厚解析
- 光学常数解析 (n: 折射率, k: 消光系数)



根据试料的形状和部位，可轻松定制测量顺序



式样 Specifications

		OP-A1	OP-A2	OP-A3
波长范围	Wavelength Range	230~800nm	360~1100nm	900~1600nm
膜厚范围*	Film Thickness Range	1nm~35μm	7nm~49μm	16nm~92μm
样品尺寸	Sample Sizes	Max. 200mm×200mm×17mm		
点径	Spot Sizes	φ 5μm (反射40倍镜头), 改造后可达到3μm		
tact time	Measurement Time	1秒/1点		
尺寸	Sizes	本体 (W555×D537×H559mm), 控制单元		(W500×D180×H288mm)
功用	Utilities	750 VA		

※ 上述式样是带有自动XY平台。

※ release时期是 OP-A1 在2016年6月末、OP-A2、OP-A3预定2016年9月。

* 膜厚范围是SiO₂换算。

- 记载产品的外观式样和软件，可能由于改良，在未通知的情况下变更。
- 公司名，商品名等是各个公司的商标，登陆商标。
- 禁止转载本式样书中的任何内容